

## Highlights

- Innovatives Polierpad für den Rapid-Thinning-Prozess von Pureon
- Beste Wahl für das SiC-Polieren
- Oberflächengüten bis zu 3 nm Ra
- Äusserst wettbewerbsfähig im Vergleich zu Schleifprozessen
- Sorgt für eine hervorragende Werkstückgeometrie und -ebenheit ohne Kantenverrundung
- Abrichtbares System, geeignet für ein- und doppelseitige Maschinen
- Beste Resultate bei Verwendung von PURE-DS-RT-Suspensionen von Pureon

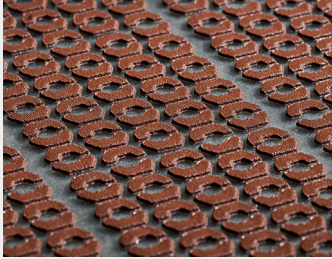
## Komposit Polierpad

# IRINO-PROSiC

Mit dem IRINO-PROSiC-Komposit Polierpad stellen wir eine innovative Ergänzung unserer IRINO-Familie von Komposit Polierpads vor. IRINO-PROSiC wurde speziell für das Polieren von Siliziumkarbid (SiC) entwickelt und liefert hervorragende Ergebnisse bei SiC-DMP-Prozessen (Direct Mechanical Planarization).

In Kombination mit der Suspension PURE-DS-RT eignet sich IRINO-PROSiC hervorragend für das Rapid-Thinning-Verfahren und bietet eine äusserst wettbewerbsfähige Alternative zu herkömmlichen SiC-DMP-Schleifverfahren. Diese innovative Kombination erzielt nicht nur eine hervorragende Oberflächenqualität, sondern sorgt auch für beeindruckende Abtragsraten. Damit ist sie ideal für Anwendungen geeignet, die einen reibungslosen Übergang direkt zu CMP (Chemical Mechanical Planarization) erfordern.

Dank seiner selbstklebenden Rückseite kann IRINO-PROSiC mühelos auf jede vorhandene Metallträgerplatte angebracht werden, was die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz bei SiC-Polieranwendungen erhöht. Ganz gleich, ob Sie eine hohe Oberflächenqualität oder einen hervorragenden Materialabtrag wünschen – IRINO-PROSiC ist die optimale Wahl für die fortschrittliche SiC-Bearbeitung.



IRINO-PROSiC Komposit Polierpad.



IRINO-PROSiC Komposit Polierpads werden für die Verwendung mit PURE-DS-RT-Diamantsuspensionen empfohlen.



Pureon bietet eine breite Palette an massgeschneiderten Lösungen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

### Produkteigenschaften

Belagstärke ..... 1 mm  
 Bindungsart ..... Resin  
 Trägermaterial ..... Polycarbonat  
 Typische Anwendung ..... SiC Wafer

### Bestellinformation

Bestellnummer..... IRINO-PROSiC OD475-ID200mm-PU1-PSA-D1  
1 2 3 4 5

- ❶ Aussendurchmesser..... 200 – 1'200 mm one-piece  
 Für grössere Durchmesser mehrteilig  
 Sondergrössen sind auf Anfrage erhältlich
- ❷ Innendurchmesser..... Optional (frei wählbar)
- ❸ Verpackungseinheit..... 1 Stück / Box
- ❹ Rückseite / Montage..... PSA (selbstklebend)
- ❺ Zeichnungsindex..... Optional

### Anwendungsempfehlungen

Dressing ..... Vor dem ersten Einsatz muss das IRINO-PROSiC-Pad mit unserem Abrichtwerkzeug MicroDress abgerichtet und planarisiert werden.

Diamant-Suspension..... Es wird eine PURE-DS-RT-Suspension empfohlen sowie eine wasserlösliche Diamantsuspension, die einen hohen und gleichmässigen Materialabtrag gewährleistet.  
 Kein Trockenlauf. Suspensionen auf Basis organischer Lösungsmittel und Öle können das Pad beschädigen und werden daher nicht empfohlen.

### Polierparameter

Polierdruck..... Empfohlen: 0,2 kg/cm<sup>2</sup>  
 Umfangsgeschwindigkeit ... Empfohlen: 2 m/s, max. 3 m/s

### Kontakt

sales@pureon.com  
 www.pureon.com

